

Microscopie électronique

Scanning Electron Microscopy

→ Equipement

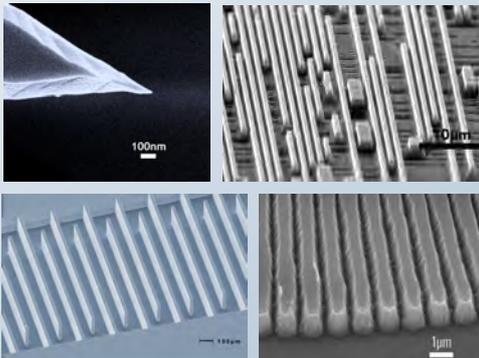


JEOL JSM 6460



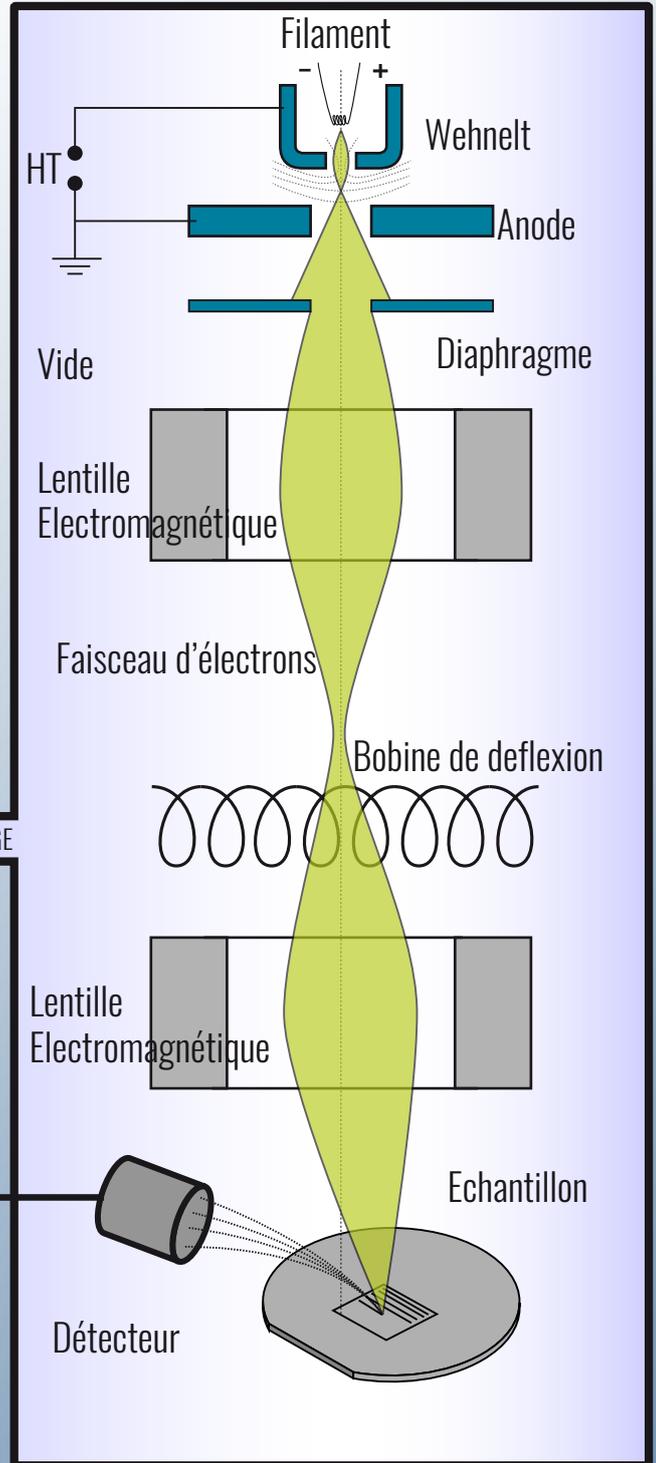
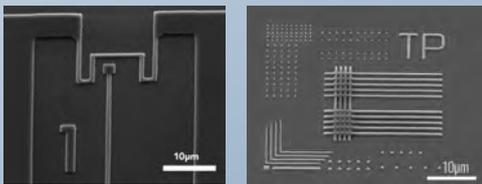
FEI Inspect S50

→ Analyse et métrologie



→ Lithographie électronique

Système Raith sur Jeol JSM6460



VUE EN COUPE D'UNE COLONNE DE MEB



Centrale de Technologie
en Micro et nanoélectronique

